

VACUUM2014 - 真空展に出展

優れた製品パフォーマンスを実感できるデモンストレーションと稼働展示

キャノンアネルバ株式会社（社長：酒井純朗、本社：神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1、以下：キャノンアネルバ）は、10月15日～17日の3日間、東京ビッグサイトにて開催される“VACUUM2014 - 真空展”に出展します。



キャパシタンスゲージ M-342DG

■〈近日発売〉成膜プロセスに対応「キャパシタンスゲージ M-342DG 1Torr ヘッド」

昨年の発売以来様々な産業分野で採用実績を増やしている、業界トップクラスのスペックを実現した隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」シリーズに、成膜プロセスの圧力測定に対応する1Torr ヘッドが加わります。弊社ブースでは、発売済みの10/100/1000Torr ヘッドの実機と共に、2015年初頭発売予定の1Torr ヘッドのサンプル品を稼働展示します。同シリーズのコンセプトである「高精度で安定した圧力測定」を測定デモンストレーションを通じてご紹介します。

■ヘリウム漏れ検知器、ガス分析装置、新概念の冷凍トラップを稼働展示

シンプルな操作性と高い検知性能を両立し、世界中で多数の採用実績をもつヘリウム漏れ検知器「HELEN(ヘレン)シリーズ」、使いやすさを徹底的に追求し、多用途に対応するガス分析システムのエントリーモデル「Cシリーズ」、別置きコンプレッサユニットとヘリウム配管を廃し、圧倒的な省スペースと省エネルギーを実現する冷凍トラップ「SCトラップ(仮称・2015年発売予定)」のプロトタイプを稼働展示します。

■クライオポンプ、真空計などの主力製品の他、成膜装置、サービス事業をご紹介

優れた省エネルギー性能を有するクライオポンプ「POWER Ecoシリーズ」の実機展示、及びポンプ動作時の動画を上映します。動作時の圧倒的な静粛性にて「POWER Ecoシリーズ」の省エネルギー性能を実感いただけます。この他、真空計、真空ポンプなどの主力製品の実機展示に加え、真空成膜装置や部品の洗浄サービス、受託加工サービスをパネルでご紹介します。

■VACUUM2014 - 真空展

- ・会期： 2014年10月15日(水)～10月17日(金) (<http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>)
- ・会場： 東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場) 東2ホール
- ・キャノンアネルバブース： V-042番

- 報道関係者のお問い合わせ先：キャノンアネルバ株式会社 経営企画センター 044-980-5121
- その他のお問い合わせ先：同 フィールドソリューション事業部 FS 販売統括部 044-980-3503
- キャノンアネルバ ホームページ：<http://www.canon-anelva.co.jp/>

<主な展示品のご紹介>

1. 高精度で安定した圧力測定 隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」

- ・大気圧～低真空領域の高精度・絶対圧測定が可能な隔膜真空計。
- ・小型シリコン MEMS チップ製ダイヤフラムを採用。高精度で安定した圧力測定を実現。
- ・ゼロ点調整頻度の最小化、および電源投入後短時間で使用可能など、使いやすさを追求。
- ・温度調整型と同等の測定性能。置き換えにより大幅なコストダウンが可能。
- ・低圧側に広い実用圧力測定範囲により測定圧力によってはゲージ総数の削減が可能。
- ・現行のトランスデューサ型真空計の専用表示器「M-601GC」「M-603GC」に適合。
- ・フルスケール圧力で 1.33kPa(10Torr)、13.3kPa(100Torr)、133kPa(1000Torr)の 3 種類をラインアップ。2015 年初頭に成膜プロセスの圧力測定に対応可能な 133Pa(1Torr)を発売予定。



キャパシタンスゲージ M-342DG

2. 着脱式ハンドコントローラー付 ヘリウム漏れ検知器「HELEN (ヘレン)」

- ・本体から着脱可能なカラー液晶パネル付ハンドコントローラーを標準装備。最大 8m まで伸びるコード付きで、使いやすさに優れ、大型装置などの漏れ試験にも対応。
- ・重さ 42kg で可搬性に優れた M-212LD、および大型粗引きポンプを装備した M-222LD、スニファー法^{※1}専用タイプの M-232LD を展示予定。



ヘリウム漏れ検知機 M-222LD



着脱式ハンドコントローラー

※1 (ヘリウム漏れ試験について) 試験体内部をヘリウム漏れ検知機内蔵の真空ポンプで排気し、外側からヘリウムを吹きかけて漏れ検知機で検知する「真空吹付法」の他、試験体内部をヘリウムで加圧し、外側に漏れてくるヘリウムをプローブで吸い込み検知する「スニファー法」などの試験方法があります。

3. ガス分析装置のエントリーモデル「コンパクト型ガス分析システム C シリーズ」

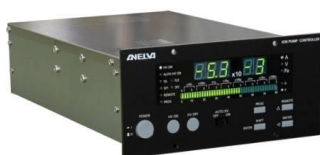
- ・分析管、コントローラー、排気系(ターボ分子ポンプ+粗引きポンプ)、ガス導入系をコンパクトで軽量のフレームに搭載し、「使いやすさ」を追求したガス分析システム。
- ・用途に応じて構成内容の選択が可能で、各種測定に対応可能。
- ・スイッチ一つで排気制御が可能。排気/測定用インターロック機能を搭載。
- ・フットプリント約 480mm×500mm で省スペース。
- ・真空計、ヒーターなどをオプションで設置可能 (写真は PC を設置した状態)。



ガス分析装置 C シリーズ

4. 海外使用可能な上位互換モデル イオンポンプ/ノーブルポンプ用制御装置「P-500 シリーズ」

- ・電子顕微鏡や加速器などで使用される超高真空ポンプ「イオンポンプ/ノーブルポンプ」用の小型制御装置。
- ・視認性の高い緑色の大型 LED ディスプレイを搭載。デジタルバーグラフによる出力電流、出力電圧、圧力(真空度)の表示が可能。
- ・キャノンアネルバ製イオンポンプの現行ラインアップに対応。
- ・RoHS 指令、CE マーキングに適合し、マルチ入力電圧仕様 (AC100~240V 50/60Hz 単相) で海外での使用が可能。
- ・当社従来製品“PIC シリーズ”とリモートコネクタ、入力・出力ケーブルの互換性があり、容易に置き換えが可能。



イオンポンプ/ノーブルポンプ用制御装置 P-500 シリーズ

5. 優れた省エネルギー性能 クライオポンプ「POWER Eco」シリーズ

- ・省エネルギーの観点から、消費電力や冷却水量を低減することを目的として開発された高性能省エネルギー型のクライオポンプ。
- ・実用性に優れたポンプの起動特性とマルチ運転時の温度安定性。
- ・自己発熱機能や独自の排気パネル構造により、ヒーター無しで高速再生が可能。



クライオポンプ POWER Eco シリーズ

6. コンプレッサが不要な冷凍トラップ「SCトラップ(仮称)」【2015年発売予定】

- ・新開発高性能スターリング冷凍機の採用により、別置コンプレッサユニットとヘリウム配管を廃し、圧倒的な省スペースと省エネルギーを実現したクライオトラップ。
- ・水分に対する高い排気速度と、高コンダクタンスを両立し、ターボ分子ポンプと併用することで排気性能向上を実現。
- ・メンテナンスサイクルが長く、ランニングコスト低減にも貢献。



スターリング式冷凍トラップ SCトラップ(仮称)

7. 大気圧～超高真空の測定が可能「トランスデューサ型真空計」シリーズ

- ・「クリスタルイオンゲージ」「コールドカソードピラニゲージ」「イオンゲージ」「キャパシタンスゲージ」「ピラニゲージ」の5機種をラインナップし、各種の測定圧力領域や用途に対応。
- ・電源部とセンサー部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。
- ・大型カラーLCDパネル付表示器「M-603GC」(別売)では真空計3台の同時モニタリングが可能。



クリスタルイオンゲージ M-336MX



3チャンネル表示器 M-603GC

8. 分析管・電源部一体型質量分析計「トランスデューサ型マスフィルタ」

- ・分析管と電源部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。装置への取付けも容易。
- ・ガス組成のモニタにより、システム不具合解析やプロセススタート条件の確認に貢献。
- ・操作も容易な専用ソフトウェア「QUADVISION」を標準添付(日本語版または英語版)



トランスデューサ型マスフィルタ

9. Edwards 社製真空ポンプ

- ・加圧給油方式を採用し、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えるオイル逆流防止機構付きのロータリーポンプ「RVシリーズ」。
- ・性能、信頼性およびユーザーでの使いやすさを提供する最高レベルの理科学分野向けターボ分子ポンプ「nEXTシリーズ」。
- ・優れた排気速度と最高度の真空到達圧力を備え、クラス最高のパフォーマンスを提供するスクロールドライポンプ「nXDSシリーズ」。
- ・背圧ポンプを2種類から選択可能な高真空排気ユニット「T-Station75」。



ロータリーポンプ RV シリーズ



ターボ分子ポンプ nEXT シリーズ



スクロールドライポンプ nXDS シリーズ



ターボ排気ユニット T-Station75

10. その他の真空コンポーネント製品

- ・ 10^{-9} Pa 台の排気が可能な超高真空ポンプ「イオンポンプ」
- ・バルブ、フランジなど超高真空対応の配管部品を多数展示

11. 真空装置・保守サービス

- ・真空機器の総合メーカーだから提供できる高品質「部品洗浄・再生サービス」
- ・納品後そのまま超高真空部品として使用可能「超高真空部品の受託加工サービス」
- ・多彩な蒸着に対応・実験用にカスタマイズ可能「高真空蒸着装置 EB1900」
- ・脱泡時の液切れ現象や注入後のワーク内の気泡を解消「バッチ式注入装置」
- ・封孔時間の大幅短縮、ロボットレス・反転機構レス「バッチ式封孔装置」
- ・電子部品の開発から生産まで、多様なニーズに対応「EB1100, EC7000 スパッタ装置」
- ・MEMS・高周波デバイスに必要な高均一性を実現する生産装置「EC7400 スパッタ装置」
- ・高輝度 LED の量産に貢献する「EL3000 スパッタ装置」
- ・SiC パワーデバイス活性化アニール工程に対応「EC7200 EBAS」

<キャノンアネルバについて>

キャノンアネルバ株式会社はキャノン株式会社の100%子会社であり、真空・薄膜技術を基幹技術とした真空薄膜形成装置や真空コンポーネント製品の開発・製造・販売・保守サービスを行なっています。真空薄膜形成装置はスパッタリング方式の装置を多くラインアップし、磁性膜形成技術を用いたハードディスクの磁気ヘッドおよび磁気ディスク製造用スパッタリング装置では世界トップシェアを有しています。

当社は、長年培った磁性膜形成技術と実績を基に、2013年12月に次世代メモリーSTT-MRAMの量産向け装置を他社に先駆けて発売し、市場で高い評価を受けています。

真空展には毎年継続して出展しており、真空コンポーネント製品中心の展示を行なっています。キャノンアネルバの真空コンポーネント販売部門は、お客様とより深いリレーションシップを築くために、2013年に同フィールドサービス部門と統合し、フィールドソリューション事業部として活動を展開しています(2013年8月19日付)。「**キャノンアネルバは、お客様の最高・最良のパートナーとなります**」の事業部方針の下、お客様から様々なお声を頂戴し、販売、サービス、そして製品の質の向上に努めてまいります。